基于离子注入技术的 ZnMnO 半导体 材料的制备及光谱表征*

钟红梅* 陈效双 王金斌 夏长生 王少伟 李志锋 徐文兰 陆 卫

(中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室,上海 200083)(2005年4月13日收到2005年11月10日收到修改稿)

通过离子注入技术制备了 ZnMnO 半导体材料,研究离子注入剂量与退火对材料光谱性质的影响. Raman 光谱 研究发现 575 cm⁻¹处声子模展宽是由高剂量 Mn 注入引起的缺陷所致,退火样品 528 cm⁻¹振动模来自 Mn 相关的杂 质振动.室温光致发光谱表明,退火对高剂量注入样品的可见发光带有增强作用.

关键词:ZnMnO,离子注入,Raman光谱,室温光致发光 PACC:7855K,7360,7830,7855E

1.引 言

ZnO 是一种宽禁带直接带隙半导体材料,与其 他 [[-V] 族化合物 GaN,ZnSe,ZnS 相比具有更大的 激子束缚能.理论上在室温下就能实现紫外受激辐 射,因此 ZnO 被认为是制造紫外激光器的重要半导 体材料^[1-5].近年来实验和理论结果都表明 ZnO 基 稀磁半导体具有高于室温的居里温度^[6-8],在自旋 电子学方面有重要应用,因此 ZnO 基稀磁半导体的 制备备受重视,尤其是对 ZnMnO 的研究更为关 注^[67].目前已经发展了很多制备 ZnMnO 的方法,例 如脉冲激光沉积法^[8]、溶胶-凝胶法^[9]、离子注入 法^[10]等.

除了材料制备方法外,目前对 ZnMnO 的研究主要集中在磁性方面,而对于 Mn 在材料中的结构和 晶格振动行为则很少报道.本文采用基于离子注入 技术的方法在 ZnO 体材料中注入 Mn 元素,并对样 品进行 Raman 光谱和室温光致发光(PL)性质进行 研究.

2. 样品制备与测量

ZnO体材料是用水热法生长的,沿(0001)方向,

厚度为 5 mm. Mn 离子注入的能量为 220 eV,注入深 度约为 100 nm,注入剂量为 1×10¹⁵—1×10¹⁷/cm²,得 到 ZnMnO 的固溶体. 热退火是在 N₂ 气氛中进行, 700 ℃ 下退火 5 min. Raman 光谱室温下在 Dilor LabRam-Infinity型显微 Raman 光谱仪上测量,使用 Ar⁺的 514.5 nm 波长作为激发光源.室温 PL 光谱是 在 SPEX 1403 型光谱仪上测量得到的,使用 He-Cd 325 nm波长激光作为激发光源.

3. 结果及讨论

3.1. Raman 光谱

为了观察 Mn 注入后对 ZnO 体材料的晶格振动 的影响,我们分别测试了注入后未退火和注入后退 火样品的 Raman 光谱.图 1 给出了不同 Mn 注入剂 量未退火 Raman 光谱.从图 1 可以看到,所有样品的 振动 模除 ZnO 晶体 Raman 模中的高频支 E_2 (437 cm⁻¹ 和多声子(2个低频支的 E_2 声子)(331 cm⁻¹) 模、宽带 A_1 (LO)(575 cm⁻¹)/模以外,多声子相互作用模 (1180—1150 cm⁻¹)/也出现了.331 cm⁻¹处的声子模是由 166 cm⁻¹处的 2 个低频 E_2 模引起的¹¹¹.2 个低频 E_2 模强度随着 Mn 剂量增加有减弱趋势.为了更清楚 地观察高频支 E_2 模和 A_1 (LO)模随 Mn 剂量的变

^{*} 国家自然科学基金重点项目(批准号:G10234040)资助的课题.

[†] E-mail:hmzhong@mail.sitp.ac.cn

化 图 2 给出了 E, 模局部放大图 图 2 内插图显示 了 A₁(LO) 模的放大图. 我们可以看到, 高频支 E₂ 模强度随着 Mn 剂量增加有减弱趋势,而 A₁(LO)峰 强度随着 Mn 剂量增加有增强的趋势(见图 2 内插 图).同时从图2还可以看到 随着 Mn 剂量增加 高 频支 E2 模宽化、线型不对称程度增加、峰位红移, 且 A₁(LO) 峰位也发生红移.高频支 E₂ 模的这些变 化与我们以前 ZnMnO 纳米粉体实验现象基本相似. 在 ZnMnO 纳米颗粒中 Baman 线型的展宽和红移是 由于 Mn 随机替代了原来的 Zn 原子导致结构无序 引起的^[12].在本材料体系中,可以认为高剂量 Mn 离 子注入过程在材料中引起了损伤和随机替代 Zn 原 子而导致了无序.因此有可能形成局部无序 ZnMnO 固溶体,一般 LO 声子强度应该随着晶体质量变好 而增强^[13],Mn 注入对材料引起的损伤应该使 LO 声 子强度减小 在我们的实验里恰恰相反.575 cm⁻¹处 的 LO 声子强度随着 Mn 注入剂量的增大而增强 同 时声子峰展宽.在 P 注入和其他离子注入的 ZnO 样 品中,也观察到这个宽带^{14]}.因此,A₁(LO)(575 cm⁻¹)峰强度的减小和峰的宽化应该主要是与缺陷 相关,缺陷模的出现是由于无序和缺陷导致了 Raman 选择定则并不严格. 目前有些研究者认为这 个宽带与 O 空位和间位 Zn 有关^[15-17].这种缺陷和 无序同时也导致了 A₁(LO) 峰位发生红移. ZnO 晶 体的 E_2 和 A_1 (LO)模仍然保留在合成后的材料中, 说明材料保持着长程有序及对称性





目前对于离子注入导致的损伤一般采取注入后



图 2 未退火样品高频 E_2 模随 Mn 注入剂量的变化曲线 内插 图是 A_1 (LO) 模随 Mn 注入剂量的变化曲线.曲线 a 和曲线 b、曲 线 c、曲线 d、曲线 e 为未注入和注入剂量分别为 1×10^{15} , 1×10^{16} 5×10^{16} $A 1 \times 10^{17}$ /cm² 的未退火样品

高温退火来消除,因此,我们对 Mn 注入后的材料在 N, 气氛中 700 ℃退火并进行 Raman 光谱测试.图 3 显示了不同剂量 Mn 注入退火后的 Ranman 光谱,实 验发现 除了 ZnO 的振动模外 Mn 注入剂量为 1 × 10^{15} 和 1 × 10¹⁷/cm² 时出现了非晶金刚石 D 峰 (1350—1370 cm⁻¹)和 G 峰(1580 cm⁻¹). Mn 注入未 退火样品的 Raman 谱中没有出现这两个峰,这说明 退火过程中引入了杂质 C.图 4 显示了退火后随 Mn 注入剂量增加 $A_{1}(LO)$ 模的变化. 从图 4 可以看出, 当 Mn 注入剂量达到 1 × 10¹⁶/cm² 时,在 528 cm⁻¹处 出现一个新的振动模,而且随着注入剂量的进一步 增大,此峰的强度也随之增强,这说明此峰是由于 Mn 的注入引起的. Yang 等^[18]在研究随 Mn 掺杂 ZnO 纳米结构实验中,认为 522 cm⁻¹处出现的模来源于 与 Mn 相关的杂质振动,因此,这更进一步表明 Mn 可能随机替代 Zn 的晶格位置形成局部无序的固溶 体 ZnMnO.我们认为 528 cm⁻¹处的峰也是来源于与 Mn 相关的局部无序杂质振动.但是这个现象在未退 火样品中没有发现,说明退火对此峰的产生有贡献, 表明退火有助于这样的无序结构形成、ZnMnO 固溶 体成分增加,所以退火后这一峰就展示出来,高温退 火过程中 Zn 可能挥发产生 O 空位 ,Mn²⁺ 可能会占 据 Zn²⁺ 的位置.因为 Mn²⁺ 的离子半径(0.08 nm)比 Zn²⁺的离子半径(0.074 nm)大,所以当 Mn²⁺占据 Zn²⁺ 位置时就会产生一些新的晶格缺陷或激活 ZnO 的本征缺陷、新的振动模可能来源于这些新的缺陷。



图 3 不同 Mn 注入剂量 700 °C N₂ 气氛退火样品的 Raman 光谱 曲线 a、曲线 b、曲线 c、曲线 d 注入剂量分别为 1 × 10¹⁵ ,1 × 10¹⁶ 5 × 10¹⁶ 1 × 10¹⁷ /cm² 的退火样品



图 4 退火样品杂质振动随注入剂量的变化曲线 曲线 a、曲线 b、曲线 c、曲线 d 注入剂量分别为 1×10^{15} $l \times 10^{16}$ 5×10^{16} $l \times 10^{17}$ /cm² 的退火样品

3.2.PL 光谱

图 5 和图 6 分别给出不同剂量 Mn 离子注入 ZnO 体材料的未退火和退火样品的室温 PL 谱. 从图 5 可以看出,没有离子注入的样品有 2 个特征 PL 峰,分别在 3.3 和 2.4 eV.3.3 eV 处较强的紫外峰是 导带电子到价带的跃迁. 中心在 2.4 eV 处的宽峰为 深能级杂质引起的可见发光带. 目前对于这个可见 发射带的发射机理认为可能与 O 空位^[19,20]、O 填 隙^[21,22]、Zn 填隙、Zn 空位^[23]有关. 在未退火样品中 随 Mn 注入剂量的增大紫外发射的 PL 峰强度明显



图 5 不同 Mn 注入剂量未退火样品的 PL 光谱 曲线 a 和曲线 b、曲线 c、曲线 d、曲线 e 为未注入和注入剂量分别为 1×10^{15} , $1 \times 10^{16} 5 \times 10^{16}$, $l \times 10^{17}$ / cm² 的未退火样品



图 6 不同 Mn 注入剂量 700 °C N₂ 气氛退火样品的 PL 光谱 曲 线 *a* 和曲线 *b*、曲线 *c*、曲线 *d*、曲线 *e* 为注入剂量 1×10^{15} /cm² 的 未退火样品和注入剂量分别为 1×10^{15} , 1×10^{16} , 5×10^{16} , 1×10^{17} /cm² 的退火样品

下降,注入剂量达到 1×10¹⁶/cm² 时,紫外发射被湮 没,可见光发射带强度也减小.但是当注入剂量增加 到 1×10¹⁷/cm² 时,可见光发射带又再次增强了.紫 外发射随注入剂量增大而湮没和可见光发射的无规 律性都是由 Mn 注入对 ZnO 体材料造成的损伤和引 起的无序造成.图 6显示退火后样品的 2 个特征峰 PL 谱随着注入剂量的增大变得更有规律性:紫外峰 宽化并逐渐湮没,可见发光带强度逐渐增强.从图 6 可以看到,注入剂量为 1×10¹⁵/cm² 的样品退火后, 紫外峰比同剂量未退火样品的紫外峰蓝移了 31 meV,但是发光强度并没有增强(见图 7).注入剂



图 7 注入剂量为 1×10^{15} / cm² 的未退火和退火样品归一化后的 紫外 PL 光谱

量为 1×10^{16} /cm² 的样品退火后,紫外发光明显增强,说明退火对低剂量的注入还是有一定的修复作用.以前有报道指出 Mn 掺杂能够使 ZnO 的带隙变宽^[24-25],因此紫外峰的蓝移是与 Mn 掺杂所引起带隙改变密切相关的.当 Mn 注入剂量大于 1×10^{16} /cm²后,可见发光带的 PL 峰强度增大的同时紫外 PL 峰湮没,这可能是由于高剂量 Mn 的注入损伤了材料

- [1] Tang Z K , Wong G K L , Yu P 1998 Appl. Phys. Lett. 72 3270
- [2] Bagnall D M, Chen Y F, Zhu Z et al 1997 Appl. Phys. Lett. 70 2230
- [3] Cao H , Zhao Y G , Ho S T et al 1999 Phys. Rev. Lett. 82 2278
- [4] Zu P, Tang Z K, Wong G K L et al 1997 Solid State Commun. 103 459
- [5] Zhang D H, Wang Q P 2001 Physics 40 741 (in Chinese)[张德 恒、王卿璞 2001 物理 40 741]
- [6] Dietl T ,Ohno H , Matsukura F et al 2000 Science 287 1019
- [7] Sato K , Katayama Y H 2001 Physica E (Amsterdam) 10 251
- [8] Jung S W , An S J , Yi G et al 2002 Appl. Phys. Lett. 80 4561
- [9] Lee H J, Jeong S Y, Cho C R et al 2002 Appl. Phys. Lett. 81 4020
- [10] Norton D P, Pearton S J, Hebard A F et al 2003 Appl. Phys. Lett. 82 239
- [11] Calleja J M , Cardona M 1977 Phys. Rev. B 16 3753
- [12] Wang J B , Zhong H M , Li Z F et al 2005 J. Appl. Phys. 97 086105

的晶格结构并且导致了更多的缺陷,这一点从 Raman 光谱上也可以看出.我们还发现,Mn 注入剂 量大于 1 × 10¹⁶/cm² 的样品在退火后的杂质带发光 强度比退火前要大,这可能是由于退火更有利于 Mn 在晶格中的扩散,造成更多的缺陷.这一点从退火的 Raman 光谱中也可以得到证明.因此我们认为,退火 只对低剂量的注入有修复晶格的能力,对高剂量的 注入则倾向于提供产生更多缺陷的机会.

4.结 论

通过离子注入技术将高剂量的 Mn 离子注入到 ZnO 体材料中,研究了未退火和退火样品的 Raman 和室温 PL 谱.研究发现样品中 A1(LO)(575 cm⁻¹) 模的宽化是由于 Mn 离子注入引起的缺陷所导致 的 退火样品在 528 cm⁻¹处出现新振动模来源于与 Mn 相关的杂质振动并且退火对此振动模的产生非 常关键.退火对高剂量注入样品的可见发光带的 PL 有增强作用.这说明退火只对低剂量的注入有修复 晶格的能力,对高剂量的注入倾向于提供产生更多 缺陷的机会.总之,离子注入剂量与注入后退火对 ZnMnO 发光性质有重要影响.

- [13] Wang J, Li Z, Xu W et al 2004 Appl. Phys. A 79 1809
- [14] Chen Z Q, Kawasuso A, Xu Y et al 2005 J. Appl. Phys. 97 013528
- [15] Youn C J, Jeong T S, Han M S et al 2004 J. Cryst. Growth 261 526
- [16] Xing Y J, Xi Z H, Zhang X D et al 2003 Appl. Phys. Lett. 83 1689
- [17] Zeng J N , Low J K , Ren Z M et al 2002 Appl. Surf. Sci. 197 362
- [18] Yang L W, Wu X L, Huang G S et al 2005 J. Appl. Phys. 97 014308
- [19] Kasa P H 1963 Phys. Rev. 130 989
- [20] Kröger F A , Vink H J 2001 J. Chem. Phys. Lett. 22 250
- [21] Hahn D, Nink R 1965 Phys. Condens. Mater. 3 311
- [22] Liu M, Kitai A H, Masche P 1992 J. Lumin. 54 35
- [23] Bylander E G 1978 J. Appl. Phys. 49 1188
- [24] Jun S W , An S J , Yi G C et al 2002 Appl . Phys. Lett. 80 4561
- [25] Tiwari A, Kvit A, Kumar D et al 2002 Solid State Commun. 121 371

Preparation of ZnMnO by ion implantation and its spectral characterization *

Zhong Hong-Mei[†] Chen Xiao-Shuang Wang Jin-Bin Xia Chang-Sheng

Wang Shao-Wei Li Zhi-Feng Xu Wen-Lan Lu Wei

(National Laboratory for Infrared Physics, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200083, China) (Received 13 April 2005; revised manuscript received 10 November 2005)

Abstract

This paper reports the fabrication of ZnMnO semiconductor by high-dose Mn implantion. We studied the influence of implantation dose and annealing on its optical properties. The broad band at 575 cm^{-1} in Raman spectrum is attributed to defects related to high-dose Mn implantion. The vibration modes at 528 cm^{-1} are considered to be associated with Mn impurities. Room temperature photoluminescence spectra show that the high-dose Mn implantion can enhance the intensity in visible band.

Keywords: ZnMnO , ion implantation , Raman spectrum , room photoluminescence properties PACC: 7855K , 7360 , 7830 , 7855E

^{*} Project supported by the Key Program of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. G10234040).

[†] E-mail:hmzhong@mail.sitp.ac.cn